

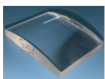
Proforma Invoice		Date	P/O No.:	Port Of Location	Port Of Destination	
ALB2207-051		9/Aug/22	/	Changchun,China	Germany	
Part No.	Marks & Descriptions	Quantity	Unit Price	Amount	Remark	
1	Plano convex cylindrical lens Dimension: 50mm*40mm Edge height: 3mm Focal length:1000mm Double surface polished AR coating@390-410nm 	5	US\$166.00	US\$830.00	/	
2	Freight of delivery by FedEx(FROM CHANGCHUN TO GERMANY)	1	US\$75.00	US\$75.00		
			Total:	US\$905.00		
SAYTOTALLY	US DOLLARS NINE HUNDRED AND FIVE ONLY.					
Payment:	100% prepay					
Paypal Account:						
Delivery Time:6 weeks after payment						
Shippment: By Express						
Package: Neutral package						

図 1 レンズ

1 手法

1.1 アンジュレータ

1.1.1 磁場制御

マトリックス型のホールプローブを用いて磁場を測定する。隣り合う電磁石の磁場が影響するため測定と電流のチューニングを繰り返し行う。アンジュレータ通過後の電子ビームの方向のずれを最小に抑えることが重要となる。

1.1.2 位置制御と読み取り

可動範囲は 825 mm ステップは 5 cm モータ (レーザを使った何か) で (um) 単位で読み出す。

1.2 分光光学系

1.2.1 grating

- Fourier Transformation
- spectroscopy

1.2.2 dispersive lens and

1.2.3 CMOS camera

1.3 分光光学系の較正

波長較正として水銀灯を用いる。400nm 領域には 2 本の輝線があり、このスペクトルを光学系で観測することで 2 つの輝線スペクトルを観測できる。輝線スペクトルをガウス関数でフィッティングし、中心位置のピクセルを対応する波長にする。2 本のスペクトル以外のピクセルは 2 本の輝線の波長 - ピクセル関係の線形性を仮定して決定する。

1.4 データ取得

データの取得をスタートすると、指定された位置で 4 枚の写真を撮る。露光時間は 10 秒。指定位置まで移動すると DAQ に信号が送られ、DAQ はカメラにシャッター信号を送信する。

1.5 電子ビーム測定

ビームラインの切り替えプロファイルモニタによるビームチューニング画像によるビームチューニング

1.6 単アンジュレータによるデータ測定

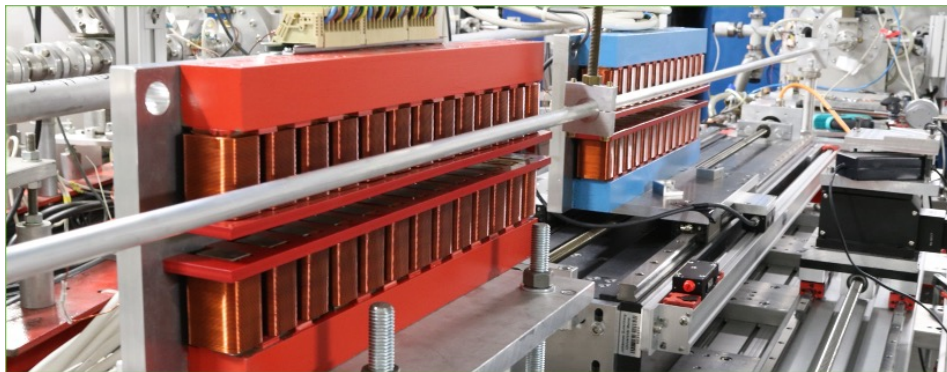


図 2 サンプルの図

• a

1. b

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3}\right) + \{1\}\Sigma \quad (1)$$